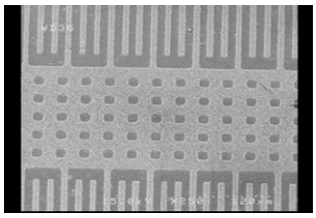
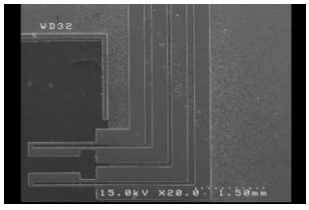
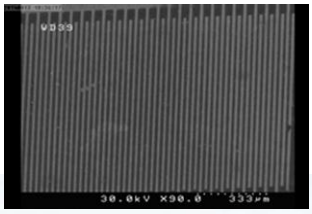
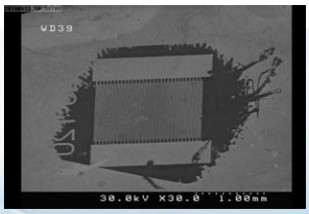
Nano Pajouhan Raga Co.

Litho-Mask reduction LA10









لیتوگرافی کاهنده ماسک فرآیندی است که طی آن طرح و الگوی دلخواه را با دقت بالا بر روی سطح مورد نظر ایجاد می‌کنند. دسترسی به دقتهای بالا، و رود به دنیای میکروسکوپی، سرعت پاسخ دهی بالا، اندازه کوچک قطعات و هزینه پایین ازجمله ویژگیهای این روش می‌باشند.

لیتوگرافی در گستره وسیعی از صنایع کاربرد فراوانی دارد که از آن جمله می‌توان به ساخت انواع حسگرها نظیر شتاب سنجها، فشار سنجها و نیز انواع محرکها اشاره کرد. یکی از کاربردهای دیگر این دستگاه در ساخت آزمایشگاههای میکرومتری بر روی یک تراشه می‌باشد که امروزه در دنیا گسترش فروانی پیدا کرده است.

- ✓ لیتوگرافی با دقت ۱۰ میکرومتر
- ✓ منبع نوری با طول موج ۴۳۵ نانومتر
- ✓ ایجاد الگو تا ابعاد دایره ای با قطر ۱۱ میلیمتر
- ✓ دارای قابلیت کنترل شدت و زمان نوردهی
- ✓ کنترل دقیق فرآیند با استفاده از دوربین دیجیتال
- ✓ دارای شیشه کالیبراسیون با الگویی از جنس کروم
- ✓ کنترل ادوات اپتیکی با دقت ۱۰ میکرومتر
- ✓ بکاربری سیستم نوین موازی سازی جهت افزایش دقت